

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第1区分

【発行日】平成26年12月25日(2014.12.25)

【公表番号】特表2013-517197(P2013-517197A)

【公表日】平成25年5月16日(2013.5.16)

【年通号数】公開・登録公報2013-024

【出願番号】特願2012-548383(P2012-548383)

【国際特許分類】

C 01 B 3/38 (2006.01)

C 07 C 31/04 (2006.01)

C 07 C 29/151 (2006.01)

C 07 C 1/04 (2006.01)

C 07 C 43/04 (2006.01)

【F I】

C 01 B 3/38

C 07 C 31/04

C 07 C 29/151

C 07 C 1/04

C 07 C 43/04 D

【誤訳訂正書】

【提出日】平成26年11月10日(2014.11.10)

【誤訳訂正1】

【訂正対象書類名】明細書

【訂正対象項目名】0 0 2 2

【訂正方法】変更

【訂正の内容】

【0 0 2 2】

したがって、本発明により、一次改質器の入口からのプロセス水蒸気のいくらかを、下流に位置する熱交換改質器に移動させることも可能である。水蒸気は、フィードガスと混合されて熱交換改質器に入る前に管支持体を冷却するように、熱交換改質器に添加される。これは、低温端が、機械的に安定である管支持体を構築することを可能にする改質器において作り出されることを示唆している。通常、管支持構造体は、約770の温度を経験し、これは、インコネルなどの高価な材料の使用を必要とする。管支持構造体の温度は、例えば、400～450まで大幅に低減され得るため、管支持構造体は、攻撃的ガスと接触せず、安価な材料、例えば、インコネル以外の材料からも構築されることができる。